

集束イオンビーム加工観察装置

H28年度地域新成長産業創出促進事業費補助金
「地域未来投資の活性化のための基盤強化事業」

細く絞ったガリウム（Ga）イオンビームを試料に照射し、周辺の原子を弾き飛ばすことで、ナノメートルオーダーの微細加工を行い、断面構造を観察します。

■ 装置の写真



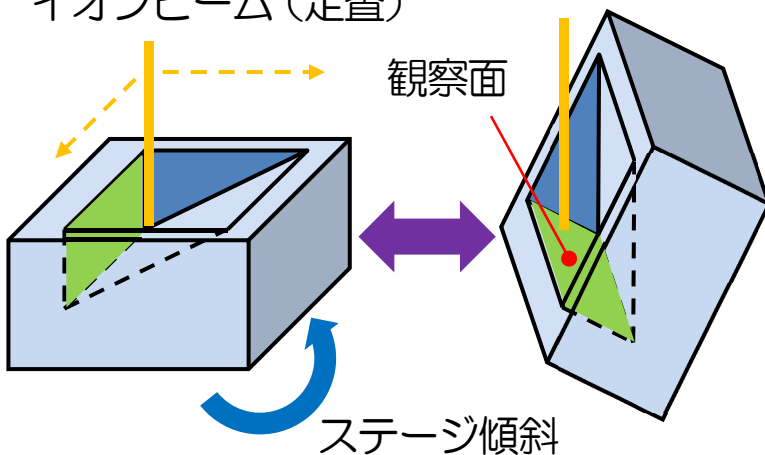
■ 主な仕様

- ・イオン源 Ga 液体金属
- ・加速電圧 1~30kV
- ・最大電流 60nA
- ・像分解能 5nm

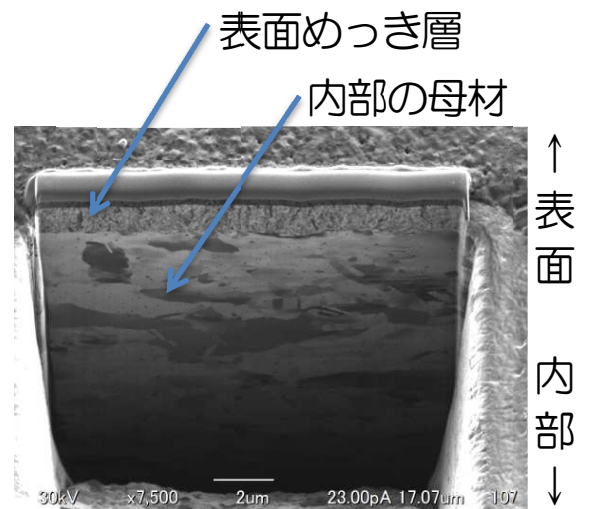
メーカー：日本電子株式会社

型式：JIB-4000

イオンビーム（走査）



加工と二次電子像による観察



観察例：電子部品めっき層の断面

担当部 金属材料部